

[I-1] [초청]

반도체 제조 공정용 건식 펌프(Dry pump)의 세계적 기술 동향 및 공정 적용 사례

박상순

Alcatel Vacuum Technology Korea

반도체 제조 공정을 비롯한 진공 산업에서는 진공 펌프에서 발생하는 backstream으로 인한 contamination이 주요 관심사가 되고 있다. 그러나 로타리 오일 펌프를 사용하는 경우에는 오일의 backstream으로 인한 contamination을 피할 수가 없어 현재는 오염 문제가 생산에 미치는 영향이 큰 반도체 공정에서는 건식 펌프를 적용/사용하고 있다. 본 발표서는 반도체 제조 공정에 필수적으로 사용되고 있는 건식 펌프(dry pump)의 세계적 기술 동향을 살펴보고 건식 펌프의 동작 원리 및 반도체 공정에서의 적용 사례 등을 살펴보고자 한다.